

공개특허실용신안공보 2000-12호(발행일 2000.4.15)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0019430	B01J 23/56	희성엥겔하드 주식회사	NO 산화촉매 조성물
특2000-0019949	C08J 5/18	에스케이씨 주식회사	내마모성이 개선된 폴리에스테르 필름의 제조방법
특2000-0019950	C08J 5/18	에스케이씨 주식회사	폴리에스테르 필름의 제조방법
특2000-0020908	C08J 5/22	에스케이씨 주식회사	미다공성 분리막 및 그 제조방법
특2000-0020980	B01J 23/22	현대중공업 주식회사	질소산화물 제거를 위한 타이타니아가 필러링된 벤토나이트에담지된 바나디아 촉매

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0019435	C08L 23/08	삼성종합화학 주식회사	이지필 필름용 수지조성물
특2000-0020046	C08G 18/10	주식회사 헵스켄	양이온성 폴리우레탄 프리폴리머의 제조 방법, 상기 프리폴리머로부터 제조되는 수분산성 폴리우레탄 또는 폴리우레탄 우레아의 제조 방법 및 그의 용도.
특2000-0020146	C08G 63/672	주식회사 코오롱	이용출성 폴리에스테르 및 그의 제조방법.
특2000-0020504	C08L 3/00	진영복	환경친화성 식품포장 용기 조성물 및 그의 제조방법
특2000-0020555	C08L 55/02	제일모직 주식회사	내충격성, 유동성 및 저광택특성이 우수한 열가소성 수지의 제조방법
특2000-0020566	C08L 53/00	삼성종합화학 주식회사	내백화성이 향상된 폴리프로필렌 수지 조성물
특2000-0020870	C08L 71/00	삼성에스디아이 주식회사	필드 에미션 디스플레이 소자의 필드 에미터용 조성물
특2000-0020899	C08L 67/00	주식회사 이래화학	이산화탄소 투과성 포장재

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0006146	C02F 1/465	현대중공업 주식회사	전해부상처리를 위한 나권형 용해성 전극 모듈
실2000-0006350	C02F 1/46	김천권	은 용액 제조기의 믹싱장치
특2000-0019473	C02F 14/0	주식회사 청우이엔이	중력식 폐수 정화 분리장치
특2000-0019492	C02F 9/00	대한통운 주식회사	고농도 유기성 하.폐수 고도처리장치
특2000-0019531	B01D 65/02	주식회사 새한	역삼투 분리막의 후처리공정
특2000-0019567	C02F 3/30	현대건설 주식회사	생물학적 하폐수 고도처리 공정
특2000-0019613	C02F 1/58	현대중공업 주식회사	스트루바이트 침전을 이용한 하,폐수 정화방법
특2000-0019678	C02F 3/34	여인봉	4케피어 씨알을 이용한 슬러지 발생문제가 없는 생물학적 폐수처리와 케피어균총을 이용한 합성수지 포장재의 대체재로 생물학적 분해가 가능한 포장재 생산
특2000-0019746	B01D 71/48	도레이새한 주식회사	폴리에스테르 부직포의 분리막 지지체
특2000-0020073	B01D 15/08	구윤모	연속 왕복식 크기배제 크로마토그래피 시스템 및 이를 이용한고분자 물질의 분리방법
특2000-0020078	C02F 11/12	포항종합제철 주식회사	제강슬러지의 고효율 탈수방법
특2000-0020134	C01B 33/32	연합화학공업 주식회사	폐수처리용 무기 응집제 및 그 제조방법
특2000-0020244	C02F 3/12	주식회사 삼양사	상향류식 수처리 장치 및 이를 이용한 순산소활성 슬러지법
특2000-0020245	C02F 9/00	주식회사 삼양사	탈질 및 탈인 공정이 포함된 폐수 처리 방법
특2000-0020516	C02F 1/28	삼성에버랜드 주식회사	담수의 수질정화 시스템
특2000-0020568	B01D 46/28	아와지 도시오	반도체 제조공정의 배기가스 처리방법 및 반도체 제조공정의 배기가스 처리장치
특2000-0020717	B01D 11/04	한국원자력연구소	용매 추출을 위한 상 분리 검출 장치
특2000-0020733	C02F 1/30	백종헌	비열 플라즈마 및 자기화를 이용한 수처리 방법
특2000-002076	C02F 3/34	대한민국(관리부 서:산림청 임업연구원) 주식회사	판막버섯을 이용한 독성 오염화폐놀의 처리방법
특2000-0021182	C02F 1/48	주식회사 한국티.앤.씨	이온 수처리기

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0019514	C09D 13/00	신우산업	축광 크레파스 제조방법
특2000-0019586	C09J 9/02	삼성전자 주식회사	전도성 접착제
특2000-0019713	C09J 9/02	삼성전자 주식회사	반도체 소자용 페이스트(Paste for semiconductor device)
특2000-0019871	C09D 5/24	제일모직 주식회사	도전성 유기-무기 하이브리드 코팅액의 제조방법
특2000-0019979	C09K 11/06	공명선	디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체 조성물
특2000-0020361	C09B 1/00	이화산업 주식회사	폴리에스텔성유 염색용 안트라퀴논 염료
특2000-0020503	C09D 7/12	이상수	바니시용 첨가제의 제조방법
특2000-0020556	C09J 163/00	화동기업 주식회사	필름형 에폭시 접착제 조성물 및 그 제조방법
특2000-0020965	C09B 62/09	주식회사 경인양행	반응성 흑색 염료 조성물
특2000-0021036	C09K 11/64	삼성에스디아이 주식회사	플라즈마 디스플레이 패널용 청색발광형광체
특2000-0021095	C09K 11/54	한국화학연구소	아연실리케이트계 녹색 형광체의 제조방법
특2000-0021122	C10C 5/00	정현창	목초액 제조장치 및 제조방법